

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2024 年 9 月 6 日 (06.09.2024)



(10) 国际公布号
WO 2024/179497 A1

- (51) 国际专利分类号:
F16L 29/00 (2006.01) **H01L 21/67** (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2024/078927
- (22) 国际申请日: 2024 年 2 月 28 日 (28.02.2024)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
202310214428.5 2023年2月28日 (28.02.2023) CN
- (71) 申请人: 北京北方华创微电子装备有限公司 (**BEIJING NAURA MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.**) [CN/CN]; 中国北京市大兴区北京经济技术开发区文昌大道 8 号, Beijing 100176 (CN)。
- (72) 发明人: 刘东旭 (**LIU, Dongxu**); 中国北京市大兴区北京经济技术开发区文昌大道 8 号, Beijing 100176 (CN)。马宏帅 (**MA, Hongshuai**); 中国北京市大兴区北京经济技术开发区文昌大道 8 号, Beijing 100176 (CN)。南建辉 (**NAN, Jianhui**); 中国北京市大兴区北京经济技术开发区文昌大道 8 号, Beijing 100176 (CN)。赵宏宇 (**ZHAO, Hongyu**); 中国北京市大兴区北京经济技术开发区文昌大道 8 号, Beijing 100176 (CN)。

- (74) 代理人: 北京天昊联合知识产权代理有限公司 (**TEE & HOWE INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS**); 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西一办公楼 5 层 1, 6-12 室, Beijing 100738 (CN)。
- (81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。
- (84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

(54) **Title:** ADAPTER APPARATUS AND SEMICONDUCTOR PROCESS DEVICE

(54) 发明名称: 转接装置及半导体工艺设备

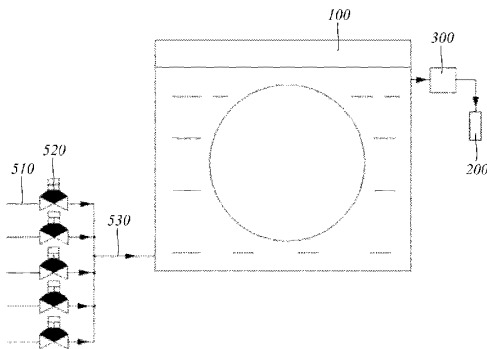


图 1

(57) **Abstract:** Provided are an adapter apparatus and a semiconductor process device using the adapter apparatus. The adapter apparatus (300) is used for transferring a water resistance meter (200) to a process groove (100). The adapter apparatus comprises a shell part (310) and a blocking part (320). The shell part is provided with a first inner cavity (313), and the first inner cavity is used for being separately in communication with the process groove and the water resistance meter. The blocking part is movably arranged in the first inner cavity to be switched between a first position and a second position. When the blocking part is located at the first position, the blocking part blocks the first inner cavity. When the blocking part is located at the second position, the process groove is in communication with the water resistance meter by means of the first inner cavity. The adapter apparatus can avoid damage to the water resistance meter, and an operator does not need to disassemble and assemble the water resistance meter, thereby enabling the problems of cumbersome operation and low device productivity to be solved.

[见续页]

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN,
TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(57) 摘要: 提供一种转接装置及使用该转接装置的半导体工艺设备, 转接装置(300)用于将水阻计(200)转接至工艺槽(100), 转接装置包括壳部(310)和封堵部(320), 壳部设有第一内腔(313), 第一内腔用于分别与工艺槽和水阻计连通; 封堵部活动地设于第一内腔内, 以在第一位置与第二位置之间切换; 在封堵部处在第一位置的情况下, 封堵部封堵第一内腔; 在封堵部处在第二位置的情况下, 工艺槽通过第一内腔与水阻计连通。该转接装置能够避免对水阻计的损坏, 无需操作人员拆装水阻计, 进而能够缓解操作繁琐以及设备产能较低的问题。